

<b>CZEŚĆ 1</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrometr AAS Perkin Elmer	ET/HG AAS	maj 2010	ZFT/PP/020/S	Sprawdzenie , Przegląd
2	Spektrofotometr Perkin	450 nm,500 nm.FI. 360 nm wzbudzenie , 455	2011.02.10	ZHZ/PP/006/S	Sprawdzenie, Przegląd
<b>CZEŚĆ 2</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy	Planowany termin Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrometr AAS 220FS Varian	ET/FAAS	maj 2010	ZFT/PP/020/S	Sprawdzenie , Przegląd
<b>CZEŚĆ 3</b>					

L.p.	Opis urządzenia	Poziomy wzorcowania/sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Jenway	320-100 nm	Maj 2010	ZCHB/PP/06W, S	Wzorcowanie, Przegląd
<b>CZĘŚĆ 4</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrometr AAS GBC	ET/FAAS	2010.06.04	ZFT/PP/173/S	Sprawdzenie , Przegląd
<b>CZĘŚĆ 5</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Unicam UV/VIS 8265	Dł. fal 480,530,600 nm	08.2010	ZB/PP/002/S	Sprawdzenie ,Przegląd
<b>CZĘŚĆ 6</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania/wzorcowania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności

1	Spektrofotometr Spekol 11	Dł.fal 540, 650 nm	2010.11.23	ZCHS/PP/091/W, S	Wzorcowanie, sprawdzanie, przegląd
	<b>CZEŚĆ 7</b>				
L.p	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania/wzorcowania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Cecil Instrument	540 nm	2012-11-03	ZM/PP/080/W,S	Wzorcowanie, przegląd
	<b>CZEŚĆ 8</b>				
L.p	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Genequant 1300		2011.10.11	ZM/PP/147/S	Sprawdzanie , przegląd
	<b>CZEŚĆ 9</b>				
L.p	Opis urządzenia	Poziomy wzorcowania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Mulicsan	405,650 nm	08.2011	PWD/PP/033/W	Wzorcowanie, przegląd
	<b>CZEŚĆ 10</b>				

L.p	Opis urządzenia	Poziomy wzorcowania /sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Helios UVB 113616	540 nm	maj 2010	LDS/PP/056/W, S	Wzorcowanie, przegląd
2	Spektrofotometr Helios	340 nm,492 nm,540 nm	2011.12.07	ZHZ/PP/081/S	Sprawdzanie, przegląd
3	Spektrofotometr Helios	260 nm, 280 nm,540 nm	2012.10.01	ZHZ/PP/217/S	Sprawdzanie, przegląd
<b>CZEŚĆ 11</b>					
L.p	Opis urządzenia	Poziomy wzorcowania /sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Spektrofotometr Biomate 3	541 nm, 235nm, 275 nm	2010.09.03	ZP/PP/136/W,S	Wzorcowanie, przegląd
<b>CZEŚĆ 12</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik płytek Dynex MRX II	405 nm, 450nm, 490 nm, 630 nm	2011.01.30	ZFT/PP/226.1/S	Sprawdzanie, przegląd
2	Automatyczny czytnik OPYS MR Dynex	405, 450,490,630 nm	2011.01.29	LDS/PP/054/S	Sprawdzanie,przegląd

<b>CZEŚĆ 13</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania/wzorcowania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik płytek Multiscan	495 nm, 540 nm, 570 nm, 595 nm	2010.12.111	ZFT/PP/003/S	Sprawdzanie, przegląd
2	Automatyczny czytnik mikroplątek Multiscan EX 355	Dł. fal 450, 492, 650, 405 nm	2010.11.30	ZB/PP/132/S	Sprawdzanie, przegląd
3	Automatyczny czytnik mikroplątek Multiscan MCC/340, RS232C		2010.09.30	ZCHS/PP/090/S	Sprawdzanie, przegląd
4	Automatyczny czytnik mikroplątek Multiscan EX Thermolabsystem	405 nm, 450 nm, 620 nm, 630 nm, 650 nm	Wzorcowanie – co 3 miesiące, przegląd - 2011.03.29	ZW/PP/115.1/W	Wzorcowanie, przegląd
<b>CZEŚĆ 14</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik mikroplątek komputer monitor LG flatron Drukarka Canon i 560, program Eacycall 3,0 do wzorcowania pipet	405 nm, 450 nm, 492 nm, 650 nm	2010.09.30	ZCHS/PP/089/S	Sprawdzanie, przegląd

<b>CZEŚĆ 15</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik mikroplitek Bio-Tek Instruments		2010.07.05	ZCHB/PP/048/S	Sprawdzanie ,przegląd
<b>CZEŚĆ 16</b>					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy sprawdzania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu	Lokalizacja	Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik mikroplitek ASYS Hitach		2010.07.07	ZCHB/PP/024/S	Sprawdzanie ,przegląd

CZEŚĆ 16					
L.p.	Opis urządzenia	Poziomy wzorcowania	Planowany termin wzorcowania sprawdzania oraz planowany termin przeglądu		Rodzaj czynności
1	Automatyczny czytnik mikroplitek PR2100 Sanofi Pasteur	450 nm, 620 nm	2010.07.07	Zw/PP/166/W	Wzorcowanie ,przegląd